



NINT 나노융합기술원

MOAFAB

분석 서비스 신청 가이드

INDEX

- 1) 서비스 신청 방법
- 2) 장비별 신청 방법
- 3) 예약 취소 방법

회원가입 및 로그인



모아팹 홈페이지 접속 후 회원가입 및 로그인
** 기존 NINT 사용자도 모아팹 회원가입 필수

<https://www.moafab.kr>

NINT MOAFAB 신청 방법



① 서비스 신청 방법 p5 ~ 13

② 장비별 신청 방법 p15 ~ 18

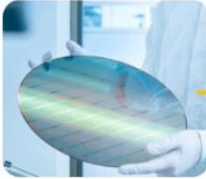
서비스 신청 방법

서비스 신청 방법 (1) - 기관/ 옵션/ 분석 서비스 신청 선택

서비스 신청

서비스 신청

Home > 펄서서비스 신청 > 서비스 신청



펄서서비스 안내

펄서서비스를 이용하실 때에는 우선 상담을 먼저 진행하신 후, 안내에 따라 공정신청을 진행하시면 됩니다.
상담은 일반상담과 기술상담으로 구분되며, 기술 상담 이용시 소정의 기술료가 추가 될 수도 있습니다.
결제유형은 반드시 작성해 주셔야 하며, 요청한 공정에 대한 대략적인 견적서는 무료 발급 됩니다.
견적서는 대략적인 비용을 측정한 것으로 실제 청구비용과는 차이가 발생할 수 있습니다.
공정신청을 하게 되면 해당 기관 담당자의 확인 및 승인 이후부터 계속 진행하실 수 있습니다.
감사합니다.

기관선택 원하시는 기관명을 선택해주세요

☐ NNFC
나노융합기술원

☐ KANC
한국나노기술원

☒ NINT
나노융합기술원

☐ DGIST
대구경북과학기술원

☐ ISRC
서울대학교 반도체공동연구소

☐ ETRI
한국전자통신연구원

옵션선택 원하시는 옵션을 선택해주세요

☒ 신규

☐ 참조

이전 서비스 신청서 | 기술상담 | 견적서

펄서서비스 신청

분석서비스 신청

① 기관선택

☒ **NINT**
나노융합기술원

② 옵션선택

☒ 신규

③ 분석 서비스 신청

분석서비스 신청

** 이후 비슷한 샘플 분석 의뢰 및 직접 사용시에는 **참조 → 이전 서비스 신청서**를 선택하시면 이전 정보를 불러올 수 있습니다.

서비스 신청 방법 (2) - 신청 정보 작성

서비스 신청

서비스 신청

Home > 펌서비스 신청 > 서비스 신청

신청 정보

신청번호

서비스 상태

분석 신청명 *

신청명은 실험 과제명 혹은 결과물(제품)등으로 명명하거나 혹은 다르게 명명하더라도 명확하게 분류할 수 있도록 명명하여 등록하기를 권장합니다.

지원 사업 *

일반 서비스

① 시료 수탁예정일 *

2024-12-28

이용목적 *

* 장비교육

신청분야 (시료 정보) *

* 교육

분석분야 *

선택

② 신청방식 *

기관 설계

③ 진행방법 *

선택

* 장비 라이선스 교육 (직접사용을 위한 교육 신청)을 원하는 경우
신청분야와 이용목적을 교육, 장비교육으로 선택

① 시료 수탁예정일 * 시료가 기관에 도착할 날짜

② 신청방식 * 기관설계 : 공정/장비 및 순서를 모두 기관에게 의뢰
본인설계 : 공정/장비 및 순서를 신청자가 직접 설계
** 분석 장비를 사용을 원하시는 분들은 본인 설계로 신청해주세요!

③ 진행방법 * 장비 의뢰진행 : 장비 담당자가 공정 진행
장비 직접사용 : 사용자가 직접 공정 진행

서비스 신청

**** 결제 및 수령 방법 작성 시 유의 사항**

① 결제 유형* 각 기관의 정산 담당자가 있는 경우 자동으로 생성

② 연구 책임자 **포스텍 소속일 경우, 필수 선택**

서비스 신청 방법 (4) - 첨부파일/ 요청 상세/ 업무 담당자 작성 및 선택

서비스 신청

 서비스 신청

Home > 웹서비스 신청 > 서비스 신청

①  첨부파일

전체 다운로드 전체 삭제

업로드

②  요청 상세

③  업무 담당자(선택)

업무 담당자

업무 담당자를 선택해주세요

초기화

- ①  첨부파일 첨부파일이 있는 경우 업로드
- ②  요청 상세 추가 요청 내용이 있는 경우 작성
예) 당일 예약 요청 시 날짜 및 시간 작성 / 액체 질소 요청 등
- ③  업무 담당자 특정 업무 담당자에게 요청할 경우 선택
(장비 담당자 선택해주시면 됩니다.)

서비스 신청 방법 (5) - 공정 절차 : 장비 선택

서비스 신청

서비스 신청

Home > 웹서비스 신청 > 서비스 신청

공정 절차

총 공정 수 : 0 예상금액 : 0원 총 공정 예상 소요 시간 : 분 (*공정 시간은 Fab 시설 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.)

단일공정

장비/공정추가

모두삭제

목록

저장

공정 신청

장비/공정추가

장비번호/장비명 공정그룹(대) 전체

공정번호/공정명

장비/공정 목록

공정그룹(대)	자동배정	장비상태	공정번호	공정명	선택
1	분석 및 기타	가동중	PT0512	나노재료의 표면 및 형태관찰/ 성분분석 EDS	선택
2	분석 및 기타	가동중	PT0512	나노재료의 표면 및 형태관찰/ 성분분석 EDS	선택
3	분석 및 기타	가동중	PT0511	나노재료의 표면 및 형태관찰/ 성분분석 SEI/ BEI/ EDS	선택
4	분석 및 기타	가동중	PT0512	나노재료의 표면 및 형태관찰/ 성분분석 EDS	선택
5	분석 및 기타	가동중	PT0510	나노재료의 표면 및 형태관찰/ 성분분석 SEI/ BEI/ EDS	선택
6	분석 및 기타	가동중	PT0512	나노재료의 표면 및 형태관찰/ 성분분석 EDS	선택

선택 목록

전체삭제

공정번호 삭제

10 Page 1 of 1 Displaying 1 to 6 of 6 items

저장

닫기

① 장비/ 공정 추가 버튼 선택

- 신청방식이 [본인설계]인 경우에만 이 버튼이 활성화 됩니다.
- p4 참고

② 원하는 장비를 [장비번호/장비명]에 검색 후 선택

- 장비 별로 겹치는 공정 번호가 있으니 확인 후 예약 부탁드립니다.
- 공정 번호는 뒷 페이지를 참고해주세요.

③ 저장 선택

서비스 신청 방법 (5) - 장비 별 공정 코드

No.	장비 명	공정번호	담당자	공정 명
1	3D Conforcal Scanning Microscope (3DCSM)	PT0502	김정훈	비접촉 3D 형상측정
2	Atomic Force Microscope- II (Jupiter XR) / AFM- II	PT0756	한은영	특수모드 (PFM, KPFM, C-AFM, AMFM 등)
3	Atomic Force Microscope- II (Jupiter XR) / AFM- II	PT0755	한은영	미세탐침을 이용한 표면 형상 분석
4	Focused Ion Beam - I (Helios 600 with TKD) / FIB - I	PT0505	최혜원	3차원 가공 및 TEM 시료제작, 단면 관찰, 미세 집합조직 해석
5	Focused Ion Beam - II (Helios 650 with EBSD) / FIB - II	PT0754	이단비	3차원 가공 및 구조의 입체적 분석, 미세 집합조직 해석
6	Focused Ion Beam -III (Helios G3 CX) / FIB-III	PT0508	김성규	나노 정밀도 이온빔을 이용한 3차원 마이크로 단위 시료 제작 및 가공
7	Focused Ion Beam -IV (SMI 3050) / FIB-IV	PT0509	김정훈	3차원 가공 및 TEM 시료제작, 단면 관찰
8	High Resolution FE-SEM-I (JSM 7401F)	PT0512	신혜연	나노 재료의 표면 및 형태관찰/ 성분분석 EDS
9	High Resolution FE-SEM- II (JSM 7800F PRIME with Dual EDS)	PT0512	신혜연	나노 재료의 표면 및 형태관찰/ 성분분석 EDS
10	High Resolution FE-SEM- II (JSM 7800F PRIME with Dual EDS)	PT0511	신혜연	나노 재료의 표면 및 형태관찰/ 성분분석 SEI/ BEI/ EDS (파우더 및 자성체 측정 시 담당자와 사전협의 후 진행)
11	High Resolution FE-SEM-III (HITACHI S-4800)	PT0512	신혜연	나노 재료의 표면 및 형태관찰/ 성분분석 EDS
12	High Resolution FE-SEM-III (HITACHI S-4800)	PT0510	신혜연	나노 재료의 표면 및 형태관찰/ 성분분석 SEI/ BEI/ EDS
13	High Resolution FE-SEM-IV (JSM-IT710HR)	PT0512	한은영	나노 재료의 표면 및 형태관찰/ 성분분석 EDS
14	High Resolution Powder-XRD	PT0760	최혜원	분말 회절 분석 : 정성, 정량, 결정화도, 격자상수, 결정자 사이즈 / 격자변형평가 등 - 결정성 분말, 시료의 정성분석 및 결정구조 분석
15	HR-[S]TEM- I (2100F with Probe Cs-Corrector)	PT0514	김정훈	투과 전자 빔에 의한 나노 구조/성분분석 TEM/ STEM/ EDS/ BF/ HAADF
16	HR-[S]TEM - II (2200FS with Image Cs-corrector)	PT0513	박현진	나노구조/성분 분석(TEM/BF/DF/SAED/EF-TEM(EELS Mapping)/STEM/BF/HAADF/EDS)
17	Raman Spectroscopy	PT0817	한은영	Raman Spectroscopy (Spectrum/Mapping)
18	UV/Vis/nIR Spectrometer	PT0528	한은영	UV/Vis/nIR 측정

- 노란색으로 표시되어 있는 장비(SEM-1, 2, 3, 4)는 공정 번호가 동일합니다.
- 장비 사용 시 공정 번호가 아닌 **장비명**을 검색해주세요.
예) SEM-1 장비 예약 시, [7401] 검색

서비스 신청 방법 (6) - 공정 절차 : 진행방법/ 예약 시간 선택

서비스 신청

서비스 신청

Home > 웹서비스 신청 > 서비스 신청

공정 절차

총 공정 수 : 1 예상금액 : 100,000원 총 공정 예상 소요 시간 : 60분 (*공정 시간은 Fab 시설 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.)

단일공정 장비/공정추가 모두삭제

[JSM 7800F PRIME with Dual EDS] High Resolution FE-SEM-II 나노재료의 표면 및 형태관찰/ 성분분석 SEI/ BEI/ EDS (파우더 및 자성체 측정.... (MAFS03 - PT0511)

공정그룹: 분석 및 기타 담당자: 신혜연 진행방법: 장비 의뢰진행 수량: 1 예약시간: 2025-01-06 08:00 ~ 2025-01-06 09:00 예약변경

상세 요청 내용

작업중 체크 요소 입력 시 우측 저장 버튼을 클릭해야 해당 내용이 저장됩니다. 입력 예)의뢰 시 공정운영자와의 업무 요청 체크

저장 추가 삭제

장비 의뢰진행 ▼

장비 의뢰진행

장비 직접사용

① 진행 방법] 장비 의뢰 진행 / 장비 직접 사용 선택

- 직접 사용 유저분이 장비 의뢰 진행으로 선택 시, 서비스 비용으로 청구 됩니다.
- 꼭 알맞은 진행 방법을 선택해주세요!

② 예약 변경

- D+3 부터 예약이 가능합니다.
- **당일/ D+1/ D+2**에 예약을 원하시는 분은 꼭 장비 담당자에게 문의 바랍니다
- 직접 사용자에게 한하여 **주말 및 공휴일**도 장비 담당자에게 문의 시 예약 가능합니다.
- 1시간 단위로 예약이 됩니다.
- 2시간 이상 예약을 하고 싶으신 분은 장비/공정 추가 버튼을 눌러주세요.
- 뒷 페이지를 참고해주세요.

서비스 신청 방법 (6) - 공정 절차 : 2시간 이상 예약 방법

서비스 신청

서비스 신청

Home > 웹서비스 신청 > 서비스 신청

공정 절차

총 공정 수 : 2 예상금액 : 200,000원 총 공정 예상 소요 시간 : 120분 (*공정 시간은 Fab 시설 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.)

단일공정

장비/공정추가

모두삭제

1	[JSM 7800F PRIME with Dual EDS] High Resolution FE-SEM-II 나노재료의 표면 및 형태관찰/ 성분분석 SEI/ BEI/ EDS (파우더 및 자성체 측정.... (MAFS03 - PT0511) 공정그룹대: 분석 및 기타 담당자: 신혜연 진행방법: 장비 의뢰진행 수량: 1 예약시간: 2025-01-15 09:00 ~ 2025-01-15 10:00 예약변경 상세 요청 내용 작업중 체크 요소 입력 시 우측 저장 버튼을 클릭해야 해당 내용이 저장됩니다. 입력 예)외 시 공정운영자와의 업무 요청 체크	저장 추가 삭제
2	[JSM 7800F PRIME with Dual EDS] High Resolution FE-SEM-II 나노재료의 표면 및 형태관찰/ 성분분석 SEI/ BEI/ EDS (파우더 및 자성체 측정.... (MAFS03 - PT0511) 공정그룹대: 분석 및 기타 담당자: 신혜연 진행방법: 장비 의뢰진행 수량: 1 예약시간: 2025-01-15 10:00 ~ 2025-01-15 11:00 예약변경 상세 요청 내용 작업중 체크 요소 입력 시 우측 저장 버튼을 클릭해야 해당 내용이 저장됩니다. 입력 예)외 시 공정운영자와의 업무 요청 체크	저장 추가 삭제

- ① 9페이지를 참고하여 장비/공정 추가 버튼을 눌러 원하는 장비를 한 번 더 선택
- ② 원하는 예약시간으로 변경

서비스 신청 방법 (7) - 공정 신청 완료

서비스 신청

서비스 신청

Home > 웹서비스 신청 > 서비스 신청

총 공정 수 : 2 예상금액 : 200,000원 총 공정 예상 소요 시간 : 120분 (*공정 시간은 Fab 시설 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.)

단일공정 장비/공정추가 모두삭제

1	[JSM 7800F PRIME with Dual EDS] High Resolution FE-SEM-II 나노재료의 표면 및 형태관찰/ 성분분석 SEI/ BEI/ EDS (파우더 및 자성체 측정.... (MAFS03 - PT0511) 공정그룹대: 분석 및 기타 담당자: 신혜연 진행방법: 장비 의뢰진행 수량: 1 예약시간: 2025-01-15 09:00 ~ 2025-01-15 10:00 예약변경 상세 요청 내용 작업중 체크 요소 입력 시 우측 저장 버튼을 클릭해야 해당 내용이 저장됩니다. 입력 예)의뢰 시 공정운영자와의 업무 요청 체크	저장 추가 삭제
2	[JSM 7800F PRIME with Dual EDS] High Resolution FE-SEM-II 나노재료의 표면 및 형태관찰/ 성분분석 SEI/ BEI/ EDS (파우더 및 자성체 측정.... (MAFS03 - PT0511) 공정그룹대: 분석 및 기타 담당자: 신혜연 진행방법: 장비 의뢰진행 수량: 1 예약시간: 2025-01-15 10:00 ~ 2025-01-15 11:00 예약변경 상세 요청 내용 작업중 체크 요소 입력 시 우측 저장 버튼을 클릭해야 해당 내용이 저장됩니다. 입력 예)의뢰 시 공정운영자와의 업무 요청 체크	저장 추가 삭제

목록

저장

공정 신청

자동 배정

[공정 신청] 버튼을 눌러 예약 완료

장비별 신청 방법

장비별 신청 방법 (1)

장비별 신청



국가 나노랩 서비스 한 곳에 모아!

팹서비스 소개

팹서비스 신청

팹서비스 현황

고객센터

로그아웃

마이페이지

운영

메뉴



국가나노인프라협약체



장비별 신청

Home

>

팹서비스 신청

>

장비별 신청

전체

장비명을 입력하세요



대상기관

☒ 나노융합기술원 ☐ 한국나노기술원 ☐ 대구경북과학기술원 ☐ 서울대학교 반도체공동연구소 ☐ 한국전자통신연구원

분류

☒ 피공정 ☐ 산화공정 ☐ 포토리소그래피 ☐ 식각공정 ☐ 증착공정 ☐ 배선공정 ☐ EDS ☐ 패키징 ☐ 분석 및 기타

총 93개



목록

타일

분류	장비명	한글명	보유기관	모델명	담당자	상태	예약
분석 및 기타	Secondary Ion Mass Spectrometry (SIMS)	2차이온질량분석기	나노융합기술원	IMS 6F	김성규	가동중	 신청
식각공정	3D Profiler	3차원 프로파일러	나노융합기술원	Wyko NT1100	김병욱	가동중	신청
증착공정	4 Point Probe - 1	4단 면저항 측정기-1	나노융합기술원	CMT-SR2000N	김동은	가동중	신청

① 나노융합기술원 선택

② 원하는 장비 선택

장비별 신청 방법 (1)

장비별 신청

공정명

Q 검색

장비/공정 목록

	☐	장비번호	장비명	공정그룹(대)	공정그룹(중)	공정코드	공정명
1	☒	MAFS03	전계 방출형 주사전자현미경	분석 및 기타	분석	PT0512	나노재료의 표면 및 형태관찰/ 성분분석 E
2	☐	MAFS03	전계 방출형 주사전자현미경	분석 및 기타	분석	PT0511	나노재료의 표면 및 형태관찰/ 성분분석 S

10

Page 1 of 1

Displaying 1 to 2 of 2 items

선택

닫기

③ 원하는 분석 선택

- 공정명이 잘려서 보인다면, 10페이지 장비별 코드 참고바랍니다.

장비별 신청 방법 (2)

장비별 신청

 서비스 신청

Home > 펌서비스 신청 > 서비스 신청

신청 정보

신청번호		서비스 상태	
신청명 *	신청명은 실험 과제명 혹은 결과물(제품)등으로 명명하거나 혹은 다르게 명명하더라도 명확하게 분류할 수 있도록 명명하여 등록하기를 권합니다.		
지원 사업 *	일반 서비스		
Wafer 입고 예정일 *	2025-01-02	이용목적 *	선택
신청분야 *	선택	공정분야 *	선택
신청방식 *	본인 설계	진행방법 *	선택

① Wafer 입고 예정일

- 시료 수탁 예정일로 수정 예정입니다.
- 서비스 신청 시에 큰 문제가 되는 부분은 아니니 시료 수탁 예정일로 생각하시고 작성해주시면 됩니다.

② 공정분야

- [단일 공정] 선택해주세요.

선택

선택

단일공정

모듈공정

일괄공정

장비별 신청 방법 (2)

장비별 신청

i 공정 절차

총 공정 수 : 1 예상금액 : 0원 총 공정 예상 소요 시간 : 분 (*공정 시간은 FAB 시설 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.)

1	나노재료의 표면 및 형태관찰/ 성분분석 SEI/ BEI/ EDS (파우더 및 자성체 측정시 담당자와 사전협의 후 진행) (MAFS03 - PT0511)	
---	--	--

목록

저장

③ 공정 절차

- 서비스 신청 방법과 다르게 공정 절차 부분에 예약 시간 및 직접 사용/ 서비스 선택하는 버튼이 활성화되어 있지 않습니다.
- 이 부분도 아래쪽 [저장] 버튼을 눌러 주시면 활성화 됩니다.

이후, 서비스 신청 방법과 동일하게 작성해주시면 됩니다.

예약 취소 방법

예약 취소 방법 (1) - 서비스 현황



① 서비스 현황 선택

예약 취소 방법 (2) - 취소 / 삭제 선택

서비스 현황

Home > 앱서비스 현황 > 서비스 현황

서비스 현황

전체

모니터링

기관	신청번호 (기관신청번호)	신청명	공정그룹(대)	공정 장비수	신청방식	서비스 예약일자	서비스 상태 (기관신청상태)	상세
나노융합기술원	S2501010006	(N) 신혜연 TEST(250101)	산화공정	2	본인 설계	2025-01-15 09:00 ~ 2025-01-15 11:00	신청	상세 취소

서비스 현황

Home > 앱서비스 현황 > 서비스 현황

서비스 현황

전체

모니터링

기관	신청번호 (기관신청번호)	신청명	공정그룹(대)	공정 장비수	신청방식	서비스 예약일자	서비스 상태 (기관신청상태)	상세
나노융합기술원		(N) 신혜연 TEST	산화공정	2	본인 설계	2025-01-15 09:00 ~ 2025-01-15 11:00	작성중	수정 삭제

① 취소 버튼 선택 시 삭제 버튼이 활성화 되며 신청이 취소 됨.

- 서비스 상태 [신청] : 신청 된 상태를 뜻합니다.

② 삭제 버튼 선택 시 작성했던 신청서도 삭제가 됨

- 서비스 상태 [작성중] : 신청서를 제출하지 않고, 작성 중인 상태를 뜻합니다.